

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁵ B01D 0/00	(11) 공개번호 특 1992-0017685	(43) 공개일자 1992년 10월 21일
(21) 출원번호	특 1992-0003277	
(22) 출원일자	1992년 02월 29일	
(30) 우선권주장	P4106547.6 1991년 03월 01일 독일(DE)	
(71) 출원인	바이엘 아크티엔게젤샤프트 슈마허, 덴너 독일연방공화국 데 5090 레버쿠젠 바이엘베르크	
(72) 발명자	게르하르트 라이쓰 독일연방공화국 데 5090 레버쿠젠 베토벤스트라쎄 11 로타르 폼페 독일연방공화국 데 5093 부르샤이트 암 바이허 100아	
(74) 대리인	이병호, 최달용	
심사청구 : 없음		

(54) 공기중 산소 함량을 증가시키는 방법

요약

내용 없음

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

공기중 산소 함량을 증가시키는 방법

[도면의 간단한 설명]

제 1도는 공지된 VSA 장치의 배치도이고,
제 2도는 본 발명에 따른 공정의 시험배치도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

흡착된 상을 공기 분리압력 및 질소 흡착이 수행되는 압력보다 낮은 압력에서 탈착시키고, 탈착 후 생성된 산소 가스를 사용하여 분자체 흡착기를 공기분리시의 공기 흐름에 역류하여 적어도 부분적으로 또는 완전히 재가압시킴으로써 흡착기내 분자체 제올라이트를 사용하여 공기중 산소 함량을 증가시키는 흡착 교호 가압공정에 있어서, 가스 또는 일부의 생성 가스를 냉각시키고 냉각된 생성 가스를 사용하여 분자체 흡착기를 재가압시킴을 특징으로 하는 방법.

청구항 2

제 1항에 있어서, 분자체 제올라이트가 A 또는 X 및 Y형인 방법.

청구항 3

제 1항에 있어서, 흡착된 성분을 1기압 이하로 감소된 압력에서 탈착시키는 방법.

청구항 4

제 1항에 있어서, 흡착된 성분의 탈착이 절대압력 약 1bar에서 일어나는 한편, 공기의 분리는 절대압력 1bar 이상에서 일어나는 방법.

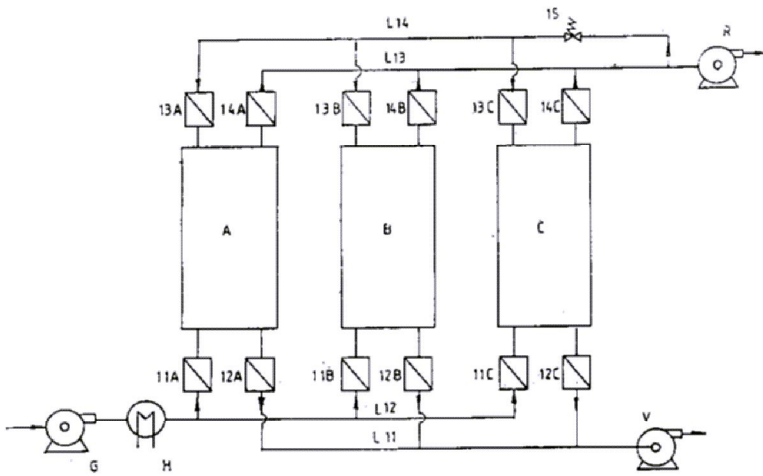
청구항 5

제1항에 있어서, 충전용으로 사용되는 생성 가스의 냉각을 분자체 흡착기의 평균 최저 온도가 0℃ 내지 -60℃인 범위에서 수행하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2

